

DIN EN 15991:2011-04 (D)

Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe - Direkte Bestimmung der Massenanteile von Spurenverunreinigungen in pulver- und kornförmigem Siliciumcarbid mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES) und elektrothermischer Verdampfung (ETV); Deutsche Fassung EN 15991:2011

| Inhalt | Seite |
|--|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Kurzbeschreibung | 4 |
| 3 Spektrometrie | 4 |
| 4 Geräte | 6 |
| 5 Reagenzien und Hilfsmittel | 7 |
| 6 Probenahme und Probenvorbereitung | 7 |
| 7 Kalibrierung | 7 |
| 8 Durchführung | 8 |
| 9 Wellenlängen und Arbeitsbereich | 9 |
| 10 Berechnung der Ergebnisse und Auswertung | 9 |
| 11 Angabe der Ergebnisse | 10 |
| 12 Präzision | 10 |
| 13 Prüfbericht | 10 |
| Anhang A (informativ) Ergebnisse des Ringversuches | 11 |
| Anhang B (informativ) Wellenlängen und Arbeitsbereich | 16 |
| Anhang C (informativ) Mögliche Störungen und ihre Beseitigung | 17 |
| Anhang D (informativ) Angaben zur Bewertung der Unsicherheit des Mittelwertes | 20 |
| Anhang E (informativ) Handelsübliche zertifizierte Referenzmaterialien | 21 |
| Anhang F (informativ) Angaben zur Validierung eines auf der Kalibrierung mit flüssigen Standards basierenden Analysenverfahrens am Beispiel von SiC und Graphit | 22 |
| Literaturhinweise | 25 |